

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 1 区分
 【発行日】平成24年8月23日 (2012.8.23)

【公表番号】特表2011-527578(P2011-527578A)
 【公表日】平成23年11月4日 (2011.11.4)
 【年通号数】公開・登録公報2011-044
 【出願番号】特願2011-517568(P2011-517568)
 【国際特許分類】

C 1 2 M 3/04 (2006.01)

【 F I 】

C 1 2 M 3/04 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月6日 (2012.7.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

気体透過性の培養装置において、

アクセスポートと、

側壁、上壁、および底壁と、

複数のスキャホールドであって、1つのスキャホールドが別のスキャホールドの上方に置かれ、細胞コンパートメントを形成する空間によって各々分離されている、複数のスキャホールドと、

細胞コンパートメントにアクセスポートを接続するマニホールドと、

1つ以上の気体コンパートメントであって、雰囲気気体に連通している開口部を有し、気体透過性の材料から構成された1つ以上の壁を有し、該1つ以上の壁はスキャホールドではない、気体コンパートメントと、を備え、

気体コンパートメントの気体透過性の材料から構成された前記1つ以上の壁は、スキャホールドに対しほぼ垂直に配向されている、装置。

【請求項 2】

スキャホールドはスキャホールド開口部を有し、気体コンパートメントはスキャホールド開口部を貫通している、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

各細胞コンパートメントに前記気体透過性の材料の1つの壁が存在している、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

側壁の少なくとも一部は気体透過性の材料から構成されている、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 5】

側壁は気体透過性の材料から構成されていない、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 6】

気体コンパートメントへの開口部が1つ存在し、底面、上面、または側面上に配置されている、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 7】

気体コンパートメントへの開口部は2つの対向する壁上に配置されており、気体コンパ

ートメントは気体透過性の前記装置全体を通じる開口部である、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 8】

気体コンパートメントへの開口部の形状はほぼ矩形である、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 9】

スキャホールドはポリスチレン材料を含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 10】

気体コンパートメントの前記 1 つ以上の壁の気体透過性の材料はシリコンである、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 11】

前記シリコンの厚みは 0.56 ミリメートル（約 0.022 インチ）以下である、請求項 10 に記載の装置。

【請求項 12】

2 つのアクセスポートが前記装置の対向する端部上に配置されている、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 13】

気体コンパートメント開口部は矩形であり、気体コンパートメントへの開口部の最も長い側面は、近傍にアクセスポートが存在する対向する端部に対し、ほぼ垂直である、請求項 12 に記載の装置。

【請求項 14】

気体コンパートメント支持構造を含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 15】

最も上のスキャホールドの上方の空間は、他のスキャホールド間のいずれの空間よりも大きい、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 16】

間隙がスキャホールドと壁、スキャホールドに隣接している気体コンパートメントの側壁、前記 1 つの壁またはその両方との間に存在している、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 17】

気体コンパートメントへの開口部の幅は 2.54 ミリメートル（0.1 インチ）以上である、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 18】

いずれかのスキャホールドの上面上の最も遠い位置から気体透過性の材料までの距離は、他のすべてのスキャホールドの上面上の最も遠い位置から気体透過性の材料までの距離を超えない、請求項 1 に記載の装置。